

Винахід відноситься до оптичного приладобудування, конкретно до матеріалу для інтерференційних покриттів. Оптичні елементи з покриттям можуть бути використані у лазерній оптиці та оптоелектроніці.

Наведений склад матеріалу для покриття з низьким показником заломлення, що містить в основі магній фторид, та матеріалу для покриття з високим показником заломлення, що містить в основі цинк сульфід, що додатково містять лантан (III) сульфогторид у масовому співвідношенні, % мас:

лантан (III) сульфогторид -	10,0÷15,0;
магній фторид -	85,0÷90,0
та	
лантан (III) сульфогторид -	10,0÷15,0;
цинк сульфід -	85,0÷90,0.